フォンアルデンヌジャパン株式会社

本社所在地	〒105-0014 東京都港区芝 2-3-12 芝シムラビル 4 階
電話番号	03-6435-1700
FAX	03-6435-1699
WEB サイト	http://www.vonardenne.biz
設立年	2017 年
資本金	円
従業員数	名
代表取締役	Ichiro Iwaki

【企業概要】

真空成膜装置の老舗　フォンアルデンヌ社の日本法人。　スパッタ、電子ビーム、蒸着などの成膜技術を搭載した大型の成膜装置を得意としています。固有のセンサー技術としては、プラズマ発光分析装置（PEM）があります。酸化膜のスパッタ速度を上げる為に遷移状態を維持するプラズマ制御は、フォンアルデンヌが量産技術として提唱しました。

最新の制御システム「VA Procos 2」は、分光強度の変化から、高速応答により、最適な成膜条件を維持し、ロールツーロールの生産歩留まり向上に寄与します。薄膜の種類ごとに最適な検知・制御系とプログラミングを実現しています。

この他、堆積膜の膜厚、光学特性、電気特性を計測する非接触センサーの自社装置への組み込みも行っております。レンズ向け成膜、光学薄膜成膜装の製造装置の個別設計にも対応しています。

【応用分野別製品分類】

IOT／AI 用センサ　　製造現場用センサ

【50 音順製品別分類】

・厚みセンサ
・分光センサ / 分光器
・静電容量変位計